

装置と場所の対応表 Equipment and Location Correspondence Table

共通機器センターShared Research Facilities

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ Technoplaza	X線回折装置 XRD X-ray Diffractometer	Ultima IV (Rigaku)
2				SmartLab (Rigaku)
3		テクノプラザ	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	汎用SEM 6010LV (JEOL)
4		テクノプラザ5(01I32室)		新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)
5		テクノプラザ	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7610 (JEOL)
6				FE-SEM JSM-7100 (JEOL)
7		テクノプラザ2*	電子線マイクロアナライザ EPMA Electron Probe Micro Analyzer	EPMA-8050G(Shimazu)
8		テクノプラザ	熱重量示差熱分析装置 TG-DTA Thermal Analysis	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)
9			精密熱重量ガス分析装置 TG-MS Thermogravimetry Mass Spectrometer	TG5500 SI(ティ・エイ・インストルメント) & GSD350(PFIFFER VACUUM)
10			レーザー顕微鏡 Laser Microscope	OLS4000 (Olympus)
11				OLS5100 (Olympus)
12			デジタルマイクロスコープ Digital Microscope	VH-Z100UR (KEYENCE)
13			プローブ顕微鏡 Probe Microscope	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)
14		テクノプラザ2*		高機能AFM SPM8000-FM (Shimazu)
15		テクノプラザ	光学顕微鏡 Optical Microscope	BX51(Olympus)
16			引張圧縮試験機 Mechanical Testing Machine	AG-50kNX (Shimazu)
17			ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム Zeta-Potential and Nano-Particle-size Analyzer	DelsaMax PRO(BECKMAN COUTER)
18		テクノプラザ2*	顕微ラマン分光装置 Laser Raman spectrometry	LabRAM HR Evolution(HORIBA)
19		分析解析センター3 12F30	分光エリプソメーター Spectroscopic Ellipsometer	RC2-DI-SUY (J.A.Woollam社 ジェー・イー・ウーラム・ジャパン)
20		テクノプラザ	フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	IRAffinity-1S (Shimazu)
21			顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)
22			紫外可視分光光度計 UV-Vis Spectrophotometer	V630-BIO (Jasco)
23			テラヘルツ分光光度計 Terahertz Spectrophotometer	VIR-F (Jasco)
24			紫外可視赤外分光光度計 UV-Vis-NIR Spectrophotometer	UV-3600 Plus (Shimazu)
25			分光蛍光光度計 Spectrofluoro-Photometer	FP-750 (Jasco)
26		分析解析センター3 12F30	4探針法抵抗率測定器 Measuring instrument of resistivity by 4 point probe method	RT-70V (ナブソン株式会社)
27		テクノプラザ	X線CTスキャン X-ray CT Scan	μ Ray8700(Matsusada)
28		テクノプラザ2*	スパッタリング装置 Sputtering Equipment	CFS-4ES II (SHIBAURA MECHATRONICS)
29		テクノプラザ	サーマルマネキン Thermal mannequin	TM8-22R (PT-Teknik)
30		分析解析センター3 12F30	自動接触角測定装置 Contact angle measuring device	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)
31			窒素吸着比表面積細孔分布測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)
32		09I25 クリーンルーム	マスクレス露光装置 Maskless Lithography System	DL-1000GS/SS (NanoSystem、9Fクリーンルーム)
33		分析解析センター3 12F30	偏光ゼーマン原子吸光度計 Polarized Zeeman atomic absorption spectrophotometer	Z-2300 (HITACHI)
34			質量分析計 Mass Spectrometer	AXIMA-CFR+(plus) (SHIMADZU)
35		13G27-b	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計 Mass Spectrometer	JMS-T100LP (JEOL)
36		分析解析センター3 12F30	円2色性分散計 Circular dichroism spectrometer	J-820 (JASCO)
37			2次元印刷装置(フードプリンター) Food Printer	MMP-F13S (Mastermind)
38		分析解析センター2 11B27	核磁気共鳴装置 Nuclear Magnetic Resonance, NMR	JNM-ECZL400R (JEOL)
39		テクノプラザ5(01I32室)	真空加熱蒸着装置 Vacuum Evaporation System	SVC-700T (SANYU ELECTRON)
40		テクノプラザ2*	電子ビーム蒸着装置 Electron Beam Evaporation System	SVC-700LEB (SANYU ELECTRON)
41			シリコン深掘り装置 (Deep RIE) Silicon Deep Reactive Ion Etching Machine	MUC21 ASE-SRE (SPP technologies)
42			スピンコーター Spin Coater	ACT-300A II (株式会社アクティブ)
43			プラズマ微細加工装置 Plasma microfabrication equipment	TEP-01x (立山マシン株式会社)
44			その他MEMS関連装置群(スピンコータ、ホットプレート、乾燥器等) Spin Coater etc. for MEMS	-
45		テクノプラザ5(01I32室)	小型無冷媒型 PPMS	VersaLab TM (Quantum Design)

46		分析解析センター3 12F30	半導体パラメータアナライザ	4156B (Hewlett packard)
47		テクノプラザ2*	手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)
48		分析解析センター3 12F30	純水製造装置 Pure water production equipment	WE200 (Yamato)
49		テクノプラザ	アクティブラーニングスペース Active Learning Space	打ち合わせスペース Meeting space
50			テクノ工房 Techno Studio	
51			低速切断機アイソメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)
52			恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)
53			小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)
54			小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)
55			レーザー加工機 大型 (A1 サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W
56			レーザー加工機 小型 (A3 サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)
57		テクノプラザ4	樹脂用簡易CNC切削機	MODELA model MDX-40 (ローランド ディー・ジー)
58			熱溶融積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer	Ender-3 V3 SE (Creality) Ender-3 S1 Plus (Creality)
59	大宮校舎 Omiya campus	101-2	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)
60			透過型電子顕微鏡TEM TEM (Transmission Electron Microscope)	JEM-2100 (JEOL)
61		202	(新)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	MI-4050 (日立ハイテック)
62			(旧)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	FB-2000A (日立ハイテクノロジー)
63			X線回折装置 XRD (X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku) Rintの置き換えです
64			単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST (ブルカー・ジャパン)
65			窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)
66			真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400 (JEOL)
67			ウルトラミクロトーム Ultra microtome	EM-ULTRACUT UCT (ライカ)
68			精密研磨装置 Polisher	ダイヤラップML-150P (マルトー)
69			マニュアルプローバー Manual prober	705B (日本マイクロニクス)
70			ピコ秒蛍光寿命測定装置	C11200 (浜松ホトニクス)
71			絶対PL量子収率測定装置	C9920-02G (浜松ホトニクス)
72			半導体パラメータアナライザ	4145B (Hewlett packard)
73		101-1	光学顕微鏡 Optical microscope	ECLIPSE LV100ND (ニコン)
74			ナノインプリント装置 Nanoimprint equipment	LTNIP-5000 (リソテック)
75			超臨界乾燥装置 Supercritical dryer	SCRD4 (レクザム)
76			熱処理装置 Heat treatment equipment	GFA430VN (サーモ理工)
77			スピンコーター Spin coater	ACT-300A II (アクティブ)
78			膜厚計測装置 Film thickness measuring device	FE-300 (大塚電子)
79			超音波ホモジナイザー Ultrasonic homogenizer	UP-50H (ヒールツシャー)
80		104	プロトンビームライター PBW (Proton Beam Writer)	MBS-1000 (神戸製鋼所)
81		104-1	電子スピン共鳴装置 Electron Spin Resonance Spectrometer	JES-X310 (JEOL)
82		104-3	無電解メッキ装置 Electroless metal plating equipment	A-50 (山本鍍金試験器)
83		105	超伝導量子干渉磁束計 SQUID Superconducting quantum interference device	MPMS-XL (日本カンタムデザイン)
84		107	核磁気共鳴装置 NMR (Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R (JEOL)
85		301	LC-MS (高速液体クロマトグラフィー-QTRAP 型質量分析装置) Liquid chromatography mass spectrometer	QTRAP® 5500 LC-MS/MS (AB Sciex Pte. Ltd.)
86			セルソーター (フローサイトメーター) Cell Sorter	BD FACSAria III (日本ベクトン・ディッキンソン)
87			超純水製造装置 Ultrapure water production equipment	Direct-Q UV (メルク)
88		303	放電プラズマ焼結 (SPS) 装置 Spark plasma sintering equipment	LABOX-210 (シンターランド)

*テクノプラザ2とは、交流棟1階 テクノプラザ3室隣の部屋です。

Technoplaza 2 is located next to Technoplaza3 on the first floor of Kouryu-building.

ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
89	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	立形マシニングセンタ Vertical Machining Center	MB-46VA (オークマ)
90			射出成形機 Injection Molding Machine	NPX7-1F (日精樹脂工業㈱)
91			バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE (ニコテック)
92			ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ (平和テクニカ)
93			CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q (ソディック)
94			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT (東和精機)
95			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V (東和精機)
96			油圧プレス (5t) Hydraulic press	HYP-505H (JAM)
97			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ (ミットヨ)
98			オートグラフ Universal testing machine	AG-20kNG (島津製作所)
99			ベンチグラインダー Bench grinder	FG255T (YODOGAWA)
100			圧入機 Press fitting machine	渡辺機械
101	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	バンドソー Band Saw	K-100 (ホーザン)
102			ボール盤 Drilling machine	TB131 (マキタ) DP3050R (REXON)
103			マシニングセンタ	V33i (MAKINO)
104			ターニングセンタ	LB3000EX II (okuma)
105			フライス盤	AM103 (DMGMORI)
106			フライス盤	NK-1R (IWASHITA)
107			旋盤	MATE-570S (ヤマザキマザック)
108			帯鋸盤	CRA-300 (AMADA)
109			コンタマシン	U-500 (LUXO)
110			ボール盤	ESD-460 (遠州工業)
111		4号館4101室	芝ミル(樹脂&低負荷金属用卓上CNCフライス) ※3台中2台は4101室、1台は豊洲テクノプラザ4に設置	向島テック
112			卓上旋盤	L5200型S (コスモキカイ)
113			卓上フライス盤	FK-500S (コスモキカイ)
114			卓上ボール盤	大西機械設計
115			バンドソー	BS23 (東洋アソシエイツ)
116			ベルトグラインダー	BGM-50 (日立工機)